科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年 6月 8日現在

| 機関番号:8272; 研究種目:基盤研究(研究期間:2009~201 課題番号:2156(研究課題名(和文) | 3 (C) 1 0255 新型比例摩擦ダンパの開発および振動絶縁・抑制装置への応用に関する | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 研究 | | | |
| 研究課題名(英文) | Development of New Type Linear Friction Damper and Its Application to Vibration Isolation and Reduction System | | | |
| 研究代表者 | | | | |
| 山口 秀谷 (YAMAGUCHI HIDEYA) | | | | |
| 防衛大学校・システム工学群・教授 | | | | |
| 研究者番号:80 | 1 4 3 0 1 4 | | | |
| | | | | |

研究成果の概要(和文): ばねと摩擦ダンパで構成された振動絶縁装置は単純な機構で大きな減 衰力が得られ保守管理が容易である.しかしながら,摩擦力一定のダンパでは振動が収束した 後つり合い位置からずれて止まったり,共振ピークを抑制できないなどの問題がある.このよ うな問題に対処する方法の一つとして,摩擦力を相対変位に応じて変化させるダンパ(本研究 では比例摩擦ダンパと呼ぶ)がある.本研究では傾斜レバーと円柱ブロックから構成された単 純な構造の新たな比例摩擦ダンパを提案し,基本的に期待された性能を発揮できることを数値 シミュレーションおよび実験によって検証した.

研究成果の概要 (英文): For a passive isolation system, a friction damper is often used because it is simple, inexpensive and reliable. However, the ordinary friction damper of constant friction force has performance limitation, because the isolation characteristic declines when the friction force is large, while resonant peak becomes large when the friction force is small. Furthermore, the displacement remains apart from the equilibrium position after the disturbance disappeared. In order to overcome above drawbacks, the new type of friction damper is proposed in this paper. The damper is devised to make the magnitude of the friction force proportional to the relative displacement by contacting the inclined lever with rotational spring to the cylindrical block. The experimental and numerical results verified the effectiveness of the proposed mechanism.

| 父们伏足領 | 交(| 付 | 決え | 官額 |
|-------|----|---|----|----|
|-------|----|---|----|----|

| | | | (金額単位:円) |
|--------|-------------|------|-------------|
| | 直接経費 | 間接経費 | 合 計 |
| 2009年度 | 2, 200, 000 | 0 | 2, 200, 000 |
| 2010年度 | 1,200,000 | 0 | 1, 200, 000 |
| 2011年度 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 年度 | | | |
| 年度 | | | |
| 総計 | 3, 800, 000 | 0 | 3, 800, 000 |

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学,機械力学・制御 キーワード:摩擦ダンパ,振動絶縁装置,減衰装置,摩擦力,振動抑制,制振,免震装置

1. 研究開始当初の背景

半導体検査装置のような精密機器におい ては外部から伝達される振動によって所要 の性能を発揮できなくなり,逆にプレス機の ように振動を発生する装置は他の機器に悪 影響を及ぼす.このため、従来から各種の振 動絶縁対策が講じられてきている.

特に,ばねと摩擦ダンパで構成された振動 絶縁装置は単純な機構で大きな減衰力が得 られ保守管理が容易であるため,建物などの 大型構造物にも用いられている.しかしなが ら、摩擦力一定のダンパでは振動が収束した 後つり合い位置からずれて止まったり、共振 ピークを抑制できないなどの問題がある.こ のような問題に対処するため、摩擦ダンパを 片効き化して残留変位を抑制する研究や摩 擦力を相対変位に応じて変化させるダンパ (本報告書では比例摩擦ダンパと呼ぶ)の研 究などがなされている.

ところで、研究代表者の先の研究では、振動絶縁対象物を搭載するテーブルを支点まわりに回転可能な2組のレバーと復原ばねを 介して基礎に連結する機構を提案した.この 機構では、ばねはテーブルに復原力を与える とともに、レバーの先端をテーブル側の摩擦 板に押し付けて、相対変位に比例して押し付 け力を変えるため、摩擦力も変化する.数値 シミュレーションおよび実験の結果、強制振 動においては高振動数域における伝達率を 増加させることなく、粘性減衰と同様に共振 ピークを抑制し、自由振動においては残留変 位を生じないことが確認された.しかしなが ら、摩擦力変化と復原力が連動しているため、 各々を最適に調整するのに難点があった.

2. 研究の目的

円柱ブロックと傾斜レバーを組み合わせ て、相対変位に比例して摩擦力を変化させる ことのできる新たな機構の比例摩擦ダンパ を堤案し、その特性を数値シミュレーション および実験で調べ、期待された特性の得られ ることを実証するとともに、振動絶縁・抑制 装置への応用に向けた設計指針を得る.

3. 研究の方法

先ず,新たに提案した機構の比例摩擦ダン パをモデル化し,運動方程式を導出して理論 解析を行う.次に,コンピュータによる数値 シミュレーションを行い,基本的特性を把握 する.これらの結果を元にして実験装置を作 製して実験を行い検証する.また,理論解 析・シミュレーションでは予想できなかった 現象が実験で生じた結果を分析して,理論解 析モデルを修正する.その後,再度実験を行 い効果を確認する.さらに,より簡便な機構 の比例摩擦ダンパについて検討する.このよ うな過程を繰り返して,実現可能な比例摩擦



ダンパの設計資料を得る.

4. 研究成果

(1)回転軸で支持された傾斜レバーと円柱 ブロックで構成された比例摩擦ダンパ(基本 的特性の検討)

最初に提案した機構のモデルを図1に示す. 回転軸 O_Iで回転可能な傾斜レバーが点 C で半 径 R の円柱ブロックに接触している. 円柱ブロ ックが右に移動してレバーが押し広げられると, 回転ばねにより作用する OL 回りのモーメント Mが増加し、接触点Cで円柱ブロックに働く垂 直力 P が増加するため、摩擦力 F も増加する. なお,円柱ブロックの中心 O_Bが x=0 にある場合 には垂直力 Pが0になるように回転ばねの配置 を調整し、この場合のレバーの傾きを基準傾斜 角 θ_0 , $O_B \ge O_L o_X$ 方向距離を基準長さ*l*とする. また,接触点Cを含むレバー下面(摩擦面)か ら O_I までの距離を摩擦面オフセットe, x軸か らOLまでの距離を軸オフセットhとし,円柱ブ ロックの中心 O_B がxの位置にある場合の傾斜角 を θ' ,接触点Cから軸 O_L までの距離をsとする.

ところで、本摩擦ダンパの趣旨がわかりにく いと思われるため、今後の研究で予定している 内容であるが、本摩擦ダンパを振動絶縁装置に 組み込んだ例を図2に示す.図2(b)は振動絶縁 装置の側面を表し、図2(a)はテーブル1を取り 除いて上面から見た図である.テーブル1がリ ニアガイド3および復原ばね4を介して基礎部 2に接続されてx方向に運動する.また、テーブ ル下面には円柱ブロック7が取り付けられ、こ れに接するようにレバー8が配置されている. このレバーは基礎部に固定された軸9の回りに 回転できるが、ばね10によって円柱ブロックに 押し付けられている.なお、ばね10は図1の回



1: Table, 2: Base, 3: Linear Guide, 4: Restoring Spring, 5,6: Spring Support, 7: Cylindrical Block, 8: Lever, 9: Pivot, 10: Spring, 11: Spring Support

図2振動絶縁装置の例.

転ばねと同等の作用を行う.また,2 つのレバ ーで円柱ブロックを挟んでいるのは,y方向の力 を相殺させるためである.さらに,右側にある 円柱ブロックとレバーの組は,テーブルがxの 正範囲で運動した場合のみ接触して摩擦力を発 生するが,xの負範囲で運動した場合には離れて 摩擦力を発生しないため,これらの円柱ブロッ クとレバーの組を左側に対称に設けてある.

図3は円柱ブロックを変位 $x=0\sim55$ mmの範囲 で一定速度(約55mm/s)で一往復させた場合の 変位x,円柱ブロックに作用する垂直力Pと擬 似摩擦力Qの時間変化の実験結果および数値シ ミュレーション結果を示す.なお、垂直力Pと 摩擦力Fの合力のx方向成分Oは

$$Q = Q_F + Q_P \tag{1}$$

ここに

$$Q_{F} = F \cos \theta' = \operatorname{sgn}(\dot{x}) \mu P \cos \theta'$$

$$Q_{P} = P \sin \theta'$$
(2)

となる. Q_F は本来の摩擦力成分, Q_P は回転ばね



図3 変位*x*, 垂直力*P*および擬似摩擦力*Q*の時 刻歴応答 (モデルA).



図4 変位xに対する擬似摩擦力Qの変化 (モデルA).

による復原力を含む垂直力成分であるが,実質 的にはこの合力が摩擦ダンパの力として働くの で,以後 Qを擬似摩擦力と呼ぶ.

図4は図3と同じ内容であるが、垂直力P、 擬似摩擦力Qの変位xに対する変化を示し、図 中の矢印はxの変化する方向を表す。変位xが 増加するとともに垂直力P、擬似摩擦力Qとも 増加し、xが減少に転じる瞬間に垂直力Pはス テップ状に増加してから減少し、擬似摩擦力Qは符号が逆転してから大きさが減少する。この ように、摩擦力が変位に比例して変化する特性 が検証された。図4の擬似摩擦力Qには

$$C_{Q} = \frac{dQ}{dx}\Big|_{x=0} = \frac{dQ}{d\theta'}\Big|_{\theta'=\theta_{0}} \frac{d\theta'}{dx}\Big|_{x=0}$$
(3)

で求めた擬似摩擦力 Q の代表変化率 C_Q を傾き とする直線

$$Q_L = C_O x \tag{4}$$

も示す.変位 x が小さい範囲では,擬似摩擦力 Q と変位 x の関係をこの直線で近似できると考 えられる.また,図 4 の曲線で囲まれた面積は ダンパで消散されるエネルギーに対応する.し たがって,速度 v の符号が正の場合と負の場合 との代表変化率 C_q の差が大きいほど,変位 x が 増減する間のエネルギー損失が大きくなるので, 代表変化率 C_q でダンパの性能を評価できる.

図 5 は、基準傾斜角 θ_0 および摩擦面オフセット \overline{e} を変化させた場合の無次元代表変化率 \overline{C}_{ϱ} を数値シミュレーションで調べた結果である. なお、本研究で提案する摩擦ダンパの特性を全体的に把握するために無次元パラメータ

$$\overline{x} = \frac{x}{R}, \ \overline{e} = \frac{e}{R}, \ \overline{h} = \frac{h}{R}, \ \overline{l} = \frac{l}{R}$$
(5)
$$\overline{P} = \frac{P}{P_R}, \ \overline{Q} = \frac{Q}{P_R}$$
(6)



フセット \bar{h} =0 としている.速度正の場合,常に $\bar{C}_Q > 0$ で, θ_0 とともに増加し,増加の割合は \bar{e} が大きいほど大きくなる.一方,速度負の場合, θ_0 が小さい範囲では \bar{C}_Q が負で θ_0 とともに減少 するが, $\theta_0=10 \deg$ 付近から増加し, $\theta_0=14.57 \deg$ では \bar{e} の値に係わらず $\bar{C}_Q=0$ となり,以降 θ_0 と ともに増加している.なお, $\bar{C}_Q=0$ となるのは

 $\operatorname{sgn}(\overline{x}) \mu \cos \theta_0 + \sin \theta_0 = 0, \overline{x} < 0$ (7) の場合である. この場合の角度 θ_0 を境界傾斜角 θ_{0B} とすると

$$\theta_{0P} = \tan^{-1} \mu \tag{8}$$

となり、 $\mu=0.26$ の場合には $\theta_{0B}=14.57$ deg である. 式(7)の第1,2項目はそれぞれ式(2)の Q_F , Q_P に対応し、 $\theta_0 > \theta_{0B}$ の範囲では本来の摩擦力成分よ







1:Cylindrical Block, 2:Lever Frame, 3:Friction Plate, 4:Force Sensor, 5:Spacer, 6:Pivot, 7:Linear Guide, 8:Leaf Spring, 9:Spring Holder, 10:Shaking Table, 11:Pivot Support Frame, 12:Linear Guide, 13:Force Sensor

図7 実験装置の概略.



り垂直力成分が大きくなりダンパとしての効果 は小さくなると考えられる.また, θ_0 が同じ場 合,速度が正の場合と負の場合の \overline{C}_Q の差は \overline{e} が 大きいほど大きくなる.

(2)回転軸で支持された傾斜レバーと円柱 ブロックで構成された比例摩擦ダンパ(スプ ラグ・スリップの検討)

前節では、提案した構造について期待された 特性の得られることが検証された. しかしな がら、実験装置の設定によっては図6に示す ように振動が発生し、十分な性能を発揮でき ない虞もあることがわかった. 図6の実験結 果で,変位 x が増加する際に発生する振動の振 動数は約 43Hz であり、円柱ブロックの移動速 度,オフセットや基準傾斜角などの諸元を種々 に変更しても振動数はほとんど変化しなかった. そこで、図7に示す実験装置各部の局所的な振 動を調べたところ、レバー枠2の実験モード解 析結果が図8のようになり、たわみ振動が関係 していると推定される.また、レバー枠2ある いは板ばね結合部9に質量を付加すると、円柱 ブロックの移動方向が反転した以降の振動数が 低下した. したがって, この振動には摩擦力の 作用方向が急変したことに起因する剛体モード (レバーの変形がない場合)の自由振動が含ま

れ、レバー枠 2 および板ばね結合部の慣性の影響が大きいと考えられる. 推定した振動発生の 要因を検証するため、レバーのたわみ変形と ともに摩擦係数調整用シートの圧縮変形を 考慮した解析モデルを図9に示す. 破線は変 形前の摩擦係数調整用シートおよびレバー の位置関係を表す. この解析モデルについて ラグランジェの方程式より運動方程式を導 出した. 図6における Cal.(b)は導出した式に よる数値シミュレーション結果である. x と ともに P, Qの振動が増減する様子は実験を 再現していると考えられる. なお, Cal.(a)は 図1の初期モデルで慣性力を無視した準静的 な解析結果である.

次に,前述した検討結果を考慮して改良した 実験装置の概略を図 10 に示す.構造変更の 要点は,レバー枠の剛性を増し,慣性モーメ ントを小さくしたことである.

図 11 は円柱ブロックを x=0~68 mm の範囲で 一定速度 v=56 mm/s で一往復させた場合の変位 x,



図 9 レバーと摩擦シートの変形を考慮した比 例摩擦ダンパのモデル.

垂直力 P,擬似摩擦力 Q の時間変化の実験およ び数値シミュレーション結果を示す.図 6 の結 果と較べると、移動方向が反転した直後を除 いて振動が発生しないため、改良の効果があ ったと考えられる.

(3)板ばねで支持された傾斜レバーと円柱 ブロックで構成された比例摩擦ダンパ

これまでは、傾斜レバーを回転軸で支持す る構造の摩擦ダンパを検討し、目的とした性 能を発揮できることを実験および数値シミ ュレーションにより確認したが、図 12 に示 すように、傾斜レバーを板ばね A_sB_s で支持 することにより、更に簡便でコンパクトな構 造の摩擦ダンパで同等以上の性能を発揮で きることが期待される.なお、図 12 におい て板ばねはレバーの長手方向に配置されて



図10 改良された実験装置.







図 12 縦方向板ばねで支持された比例摩 擦ダンパ.

おり,後述する横方向に配置された構造と区 別するために,「縦方向板ばね支持型比例摩 擦ダンパ」と呼ぶ.また,図1のように,前 項まで説明してきた構造を「回転軸支持型比 例摩擦ダンパ」と呼ぶ.

図13,14は、縦方向板ばね支持型比例摩擦 ダンパの実験および数値シミュレーション の一例である.図3および4と比較すると、 変位xが原点に復帰する範囲の擬似摩擦力Q が小さめであるものの、回転軸支持型と同様 の特性を有することが確認された.

図 15 は、基準傾斜角 θ_0 および摩擦面オフセット \overline{e} を変化させた場合の無次元代表変化率 \overline{C}_{Q} を数値シミュレーションで調べた結果である. \overline{C}_{Q} は、 $\dot{x} > 0$ の場合には正で θ_0 が大きいほど大きくなるが、 $\dot{x} < 0$ の場合には負で θ_{e} =15~20度付近で最小に設定できることが分かる.

なお、円柱ブロックの移動速度が大きい場 合やレバーの傾斜角6,オフセット e の設定 によっては振動が発生した.振動発生の要因 は、回転軸支持型の場合には、前項(2)で 述べたように、レバーのたわみ変形によるス プラグ・スリップと考えられたが、縦板ばね 支持型の場合には板ばね端部 B_sの横振動に よって円柱ブロックとの接触部に作用する 垂直力 P が変動するためと考えられ、振動を 抑えるためには板ばね長さ *l*_sをできるだけ短 くする必要がある.

図16は、傾斜レバーを横方向に板ばねAsBs



図 13 変位 x, 垂直力 P および擬似摩擦力 Q の時刻歴応答.



で支持する構造の比例摩擦ダンパを示す.前節で述べたように,図 12 の構造では板ばね端部 B_s の横振動が直接垂直力 P の変動を引き起こすと考えられたが,図 16 の構造にすることによってこれを避けることができると思われたためである.しかしながら,実験を行ったところ,摩擦力Fの変動を直接引き起こすようで,さらに振動が生じやすくなった.現在,引き続き振動発生の状況を詳細に調べているところである.

以上の研究より、摩擦力が変位に比例して 変化するダンパの基本的特性が確認され、振 動絶縁装置へ応用するための指針が得られ た.一方、スプラグ・スリップ振動が生じや すいため、この対策に注意する必要があるこ とが分かった.また、当初の計画では図2に 示す振動絶縁装置を作製して、その性能も検 証する予定であったが、板ばね支持方式など 当初の計画では考えていなかった構造の検 討や、スプラグ・スリップの検討などに手間 がかかったため、振動絶縁装置の検証は実施 できなかった. 今後、引き続き研究を進めて ゆく予定である.







図 16 縦方向板ばねで支持された比例 摩擦ダンパ.

5. 主な発表論文等

- 〔雑誌論文〕(計2件)
- ①山口秀谷,吉田秀久,円柱形摩擦ブロック と傾斜レバーで構成された比例摩擦ダン パに関する研究(基本的特性の検討),日 本機械学会論文集C編,査読有,76巻,765 号,2010,1178-1184.
- ②山口秀谷,吉田秀久,円柱形摩擦ブロック と傾斜レバーで構成された比例摩擦ダン パに関する研究(スプラグ・スリップの検 討),日本機械学会論文集 C編,査読有,77 巻,776号,2011,1213-1222.

〔学会発表〕(計4件)

- ①山口秀谷,吉田秀久,円柱形摩擦ブロック と傾斜レバーで構成された比例摩擦ダン パに関する研究,日本機械学会 機械力 学・計測制御部門講演会 Dynamics and Design Conference 2009, (2009.8.7),北 海道大学(北海道).
- ②山口秀谷,吉田秀久,円柱形摩擦ブロック と傾斜レバーで構成された比例摩擦ダン パに関する研究(スプラグ・スリップ問題 の検討),日本機械学会 関東支部 第16期 総会講演会,(2010.3.10),明治大学(東京 都).
- ③<u>Hideya Yamaguchi, Hidehisa Yoshida,</u> Linear friction damper consisting of cylindrical friction block and inclined lever (Investigation of fundamental property), ISMA2010, International Conference on Noise and Vibration Engineering, (2010.9.20), Leuven, Belgium.
- (4)<u>Hideva Yamaguchi</u>, <u>Hidehisa Yoshida</u>, Linear friction damper consisting of cylindrical friction block and inclined lever (Improvement to avoid sprag-slip problem and analytical model to verify cause), (2011.7.21), Baltimore, USA.
- 6. 研究組織

(1)研究代表者

山口 秀谷 (YAMAGUCHI HIDEYA) 防衛大学校・システム工学群・教授 研究者番号: 80143014

```
(2)研究分担者
```

吉田 秀久 (YOSHIDA HIDEHISA)
 防衛大学校・システム工学群・准教授
 研究者番号:00332635